EP 1 462 613 A1 (11)

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

- (43) Veröffentlichungstag:
 - 29.09.2004 Patentblatt 2004/40

(21) Anmeldenummer: 03006962.9

(22) Anmeldetag: 26.03.2003

(51) Int Cl.7: **F01D 5/28**, F01D 5/18

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR

Benannte Erstreckungsstaaten:

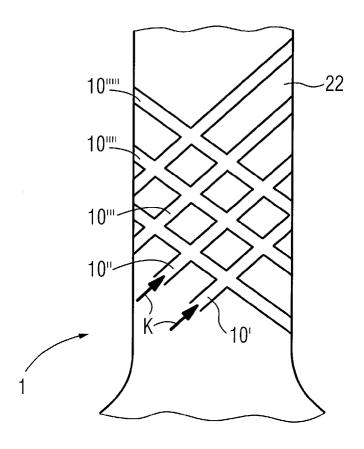
AL LT LV MK RO

- (71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 80333 München (DE)
- (72) Erfinder: Gross, Heinz-Jürgen, Dr. 45478 Mülheim (DE)
- (54)Kühlbares Schichtsystem
- (57)Auch Schichtsysteme mit Schutzbeschichtungen für den Heissgaseinsatz müssen gekühlt werden. Jedoch ist die Kühlung vielfach nicht ausreichend, da

die Kühlkanäle relativ weit von der Außenoberfläche des Schichtsystems entfernt angeordnet sind.

Ein erfindungsgemäßes gekühltes Schichtsystem (1) weist Kühlkanäle (10) auf, die sich kreuzen.

FIG 4



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein kühlbares Schichtsystem gemäß Oberbegriff der Anspruchs 1.

[0002] Aus der US-PS 5,080,557 ist ein Schichtsystem bekannt, bei dem unterhalb einer Wand eine poröse Struktur angeordnet ist, durch die ein Kühlmedium strömt. Dieser Schichtaufbau ist relativ dick und schlecht zu kühlen.

[0003] Die US-PS 5,820,337, die US-PS 5,640,767 sowie die US-PS 5,392,515 zeigen aus einem Substrat gebildete Turbinenschaufeln, bei denen unterhalb einer äußeren Wand, die dasselbe Material wie das Substrat aufweist, Kühlkanäle angeordnet sind. Die Kühlung der äußersten Beschichtung auf der äußeren Wand ist vielfach nicht ausreichend.

[0004] Die EP 1 007 271 B1 zeigt eine prallgekühlte Gasturbinenschaufel, die allerdings keine Kühlkanäle unterhalb der äußeren Wand aufweist. Die Erhebungen dienen zur Stützung der äußeren Wand und bilden keine Kühlkanäle.

[0005] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die Kühlung eines Schichtsystems zu verbessern.

[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch ein kühlbares Schichtsystem gemäss Anspruch 1.

[0007] In den Unteransprüchen sind weitere vorteilhafte Maßnahmen zur Verbesserung des gekühlten Schichtsystems aufgelistet.

[0008] Die in den Unteransprüchen aufgelisteten Maßnahmen können in vorteilhafter Weise miteinander kombiniert werden.

[0009] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind im folgenden erläutert.

[0010] Es zeigen

FIG 1	ein erstes Ausführungsbeispiel des
	kühlbaren Schichtsystems,
FIG 2	ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
	nes kühlbaren Schichtsystems, und
die FIG 3, 4, 6	weitere Modifikationen des kühlbaren
	Schichtsystems, und
FIG 5	einen speziell ausgebildeten Kühlka-
	nal.

[0011] FIG 1 zeigt ein kühlbares Schichtsystem 1. Das Schichtsystem 1 weist ein Substrat 4 auf. Das Substrat 4 ist beispielsweise eine Keramik oder ein Metall, insbesondere eine Superlegierung (nickel- oder kobaltbasiert) für Gasturbinenbauteile (Turbinenschaufel, Brennkammerauskleidung,...). Auf dem Substrat 4 ist zumindest eine Beschichtung 7 aufgebracht. Die Beschichtung 7 kann eine metallische MCrAlY-Beschichtung sein, wie sie bei Gasturbinenschaufeln verwendet wird (M= Cr oder Fe oder Ni; Y= Yttrium oder Seltene Erde). Darüber hinaus kann auf der Beschichtung 7 noch eine keramische Beschichtung, beispielsweise eine Wärmedämmschicht 9 (FIG 6), aufgebracht sein.

[0012] Ausgehend von der Oberfläche 22 des Sub-

strats 4 ist zumindest ein Kühlkanal 10 innerhalb der Beschichtung 7 ausgebildet, d.h. der Kühlkanal 10 entsteht durch Entfernen von Material der Beschichtung 7 oder durch Auftragen der Beschichtung 7 unter Aussparung eines entsprechenden Hohlraums.

Somit wird der größte Teil der Umfangsfläche des Kühlkanals 10 durch die Beschichtung 7 gebildet. Die Oberfläche 22 bleibt meistens unbearbeitet.

[0013] Eine Zufuhr von einem Kühlmedium erfolgt über eine Kühlmittelzufuhr 13, die zumindest im Substrat 4 ausgebildet ist und in zumindest einen Kühlkanal 10 führt.

Die Kühlkanäle 10 sind somit in der unmittelbaren Nähe einer äußeren Oberfläche, die mit einem Heißgas 8 in Kontakt treten kann, angeordnet. So kann die Beschichtung 7, die höheren Temperaturen ausgesetzt ist als das Substrat 4, besser gekühlt werden.

[0014] Die FIG 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines kühlbaren Schichtsystems 1.

Hier sind die Kühlkanäle 10 nicht durch Kanäle innerhalb der Beschichtung 7, sondern durch Vertiefungen 23 im Substrat 4 angeordnet.

Die Beschichtung 7 bildet einen Teil der Innenfläche des Kühlkanals 10 und schließt diesen nach außen hin ab.

[0015] Ebenso ist es möglich, dass die Kühlkanäle 10 sowohl im Substrat 4 als auch in der Beschichtung 7 angeordnet sind.

[0016] FIG 6 zeigt Kühlkanäle 10 zwischen zwei Beschichtungen 7, 9. Der Kühlkanal 10 kann auch durch eine Vertiefung 23 (gestrichelt angedeutet) in der Beschichtung 7 ausgebildet sein.

[0017] Die Kühlkanäle 10 gemäss FIG 1, 6 werden beispielsweise wie folgt hergestellt.

Auf der Oberfläche 22 des Substrats 4 bzw. der Oberfläche der Beschichtung 7 werden Bahnen mit einem Füllmaterial gelegt, die im Querschnitt den herzustellenden Kühlkanälen 10 entsprechen.

Das Substrat 4 bzw. die Beschichtung 7 wird dann mit der Beschichtung 7 bzw. der Beschichtung 9 beschichtet (Plasmaspritzen, Physical Vapour Deposition (PVP), Chemical Vapour Deposition (CVD),...).

[0018] Anschließend werden die Bahnen mit dem Füllmaterial entfernt. Das Material für die Bahnen besteht beispielsweise aus Graphit, das nach der Beschichtung mit der Beschichtung 7, 9 ausgebrannt oder ausgelaugt werden kann.

Andere Materialien für das Füllmaterial sind möglich.

[0019] Für die Herstellung der Kühlkanäle 10 gemäss FIG 2 werden in die Oberfläche 22 des Substrats entsprechende Vertiefungen 23 eingebracht. Die Vertiefungen 23 werden bspw. mit einem Füllmaterial aufgefüllt, das verhindert, dass Material der Beschichtung 7 bei der Beschichtung des Substrats 4 in die Kühlkanäle 10 eindringt.

Nach der Aufbringung der Beschichtung 7 oder der Aufbringung einer äußeren Wand wird das Füllmaterial wieder entfernt, so dass die Kühlkanäle 10 entstehen.

[0020] FIG 3 zeigt die Anordnung von Kühlkanälen 10

20

25

35

40

50

gemäss FIG 1, 2 und 6 auf einer Oberfläche eines Bauteils 1 (Schichtsystem). Das Schichtsystem 1 ist beispielsweise eine Turbinenschaufel, die sich entlang einer radialen Richtung 16 erstreckt. Zumindest ein Kühlkanal 10 erstreckt sich in einer axialen Richtung 19, senkrecht (90°) zur radialen Richtung 16.

[0021] Die Kühlkanäle 10 können auch in einem von 90° abweichenden Winkel zur radialen Achse 16 verlaufen (FIG 4), bspw. etwa parallel zur radialen Richtung $16 (0^{\circ})$.

Es können sich auch alle Kühlkanäle (10) in einer Richtung erstrecken. Gruppen von Kühlkanälen können auch parallel zueinander verlaufen.

[0022] FIG 4 zeigt eine weitere Anordnungsmöglichkeit von Kühlkanälen 10 auf einer Oberfläche 22 oder einer Beschichtung 7 eines Bauteils 1.

[0023] Zumindest zwei Kühlkanäle 10 kreuzen sich und stehen miteinander in Verbindung, d.h. ein Kühlmedium kann aus den Kühlkanal 10 in einen anderen Kühlkanal 10 strömen. Dadurch sind aufwendige, mäanderförmige Kühlkanäle überflüssig, da durch das Kreuzmuster der Kühlkanäle 10 die gesamte zu kühlende Oberfläche erfasst wird. Wenn ein Kühlkanal 10 an einer Stelle verstopft ist, kann das Kühlmedium trotzdem über die anderen Kühlkanäle weiterfliessen.

Das Kühlmedium K strömt über ein Einlass bspw. in die Kühlkanäle 10' und 10" ein. Aus dem Kühlkanal 10" gelangt das Kühlmedium unmittelbar in den Kühlkanal 10 "" und 10"", usw..

[0024] Die Kühlkanäle 10 sind hier beispielsweise in Gruppen kreuzweise zueinander angeordnet, wobei die Kühlkanäle 10 innerhalb einer Gruppe parallel zueinander verlaufen.

[0025] Andere Anordnungen von sich kreuzenden Kühlkanälen sind denkbar.

[0026] FIG 5 zeigt ein speziell ausgebildeten Kühlkanal 10, bspw. ausgehend von FIG 1.

Da der Kühlkanal 10 zumindest teilweise an die nicht dargestellte Beschichtung 7 oder an eine äußere Wand angrenzt, weist der Kühlkanal 10 des herzustellenden Schichtsystems 1 ohne Beschichtungen oder ohne äußere Wand an der Oberfläche 22 eine Öffnung 24 auf. Der Winkel α zwischen der Oberfläche 22 und der Innenoberfläche des Kühlkanals 10 an der Öffnung 24 weist einen von 90° verschiedenen Wert auf. Dies bedeutet, dass der Kühlkanal 10 gegenüber der Oberfläche 22 Hinterschneidungen 26 aufweist.

Dadurch werden bei einem hohen thermischen Gradient zwischen äußerer heißer Beschichtung 7,9 oder der Wand und Kühlkanal 10 thermische Spannungen zwischen den Beschichtungen 7,9 oder der Wand und dem Substrat 4 reduziert.

[0027] Ein solcher Kühlkanal 10 mit Hinterschneidungen 26 kann auch in der Beschichtung 7 angeordnet sein (FIG 6).

[0028] Ein Kühlkanal 10 mit Hinterschneidungen 26 in dem Substrat 4 wird beispielsweise mit einem Fräser oder Schleifkopf 25 hergestellt, der an einem Ende ku-

gel-, halbkugel- oder kegelförmig ausgebildet ist, hergestellt

Zuerst wird mit dem Fräser 25 oder einem anderen zylindrischen Bohrer ein Loch in dem Substrat 4 erzeugt, indem er in einer Bohrrichtung 29 nahezu senkrecht zur Oberfläche 22 des Substrats 4 bewegt wird. Dann erfolgt ein durch Hin- und Herbewegen des Fräsers 25 in einer Richtung 32 senkrecht zur Bohrrichtung 29, wie durch den Pfeil angedeutet, wodurch die Hinterschneidungen 26 im Substrat 4 erzeugt werden.

Die verschiedenen Stellungen des Fräsers 25 bei der Hin- und Herbewegung sind gestrichelt angedeutet.

5 Patentansprüche

- Kühlbares Schichtsystem (1), zumindest bestehend aus einem Substrat (4) und zumindest einer Beschichtung (7) auf dem Substrat (4), wobei Kühlkanäle (10) zur Kühlung verwendet werden, wobei die Kühlkanäle (10) zumindest teilweise an die Beschichtung (7) angrenzen,
- dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei Kühlkanäle (10) sich kreuzen.
- Kühlbares Schichtsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das kühlbare Schichtsystem (1) sich in einer radialen Richtung (16) erstreckt, und dass zumindest ein Kühlkanal (10) einen Winkel von 0° zur radialen Ausrichtung (16) aufweist.
- 3. Kühlbares Schichtsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das kühlbare Schichtsystem (1) sich in einer radialen Richtung (16) erstreckt, und dass zumindest ein Kühlkanal (10) einen Winkel von 90° zur radialen Ausrichtung (16) aufweist.
- **4.** Kühlbares Schichtsystem nach Anspruch 1, 2 oder

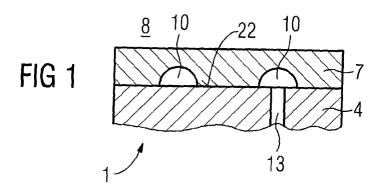
dadurch gekennzeichnet, dass
das kühlbare Schichtsystem (1) sich in einer radialen Richtung (16) erstreckt, und
dass zumindest ein Kühlkanal (10) einen Winkel

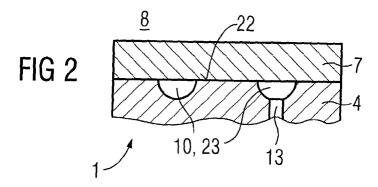
dass zumindest ein Kühlkanal (10) einen Winkel von grösser 0° bis kleiner 90° zur radialen Ausrichtung (16) aufweist.

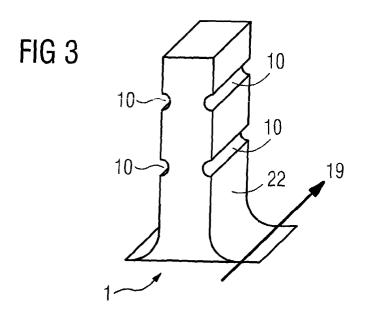
- Kühlbares Schichtsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Kühlkanal (10) zumindest teilweise innerhalb der Beschichtung (7) angeordnet ist.
- 6. Kühlbares Schichtsystem nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche. dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Kühlkanal (10) zwischen zwei Be-

schichtungen (7, 9) angeordnet ist.

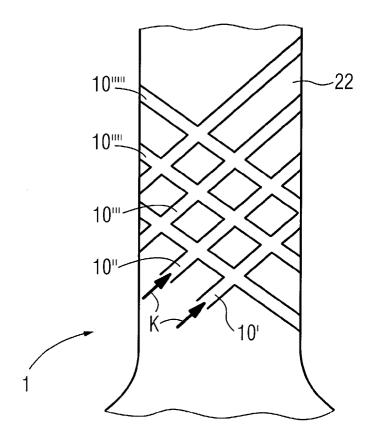
 Kühlbares Schichtsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Kühlkanal (10) zumindest eine Hinterschneidung (26) aufweist.











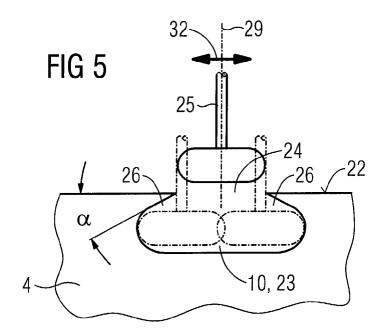
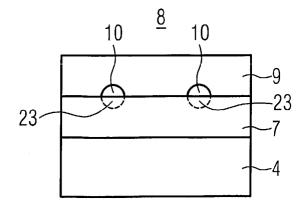


FIG 6





EP 03 00 6962

	EINSCHLÄGIGE	DOKUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokum der maßgeblich	nents mit Angabe, soweit erforderlich, en Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CI.7)
X A	GB 803 650 A (BIRMI LTD) 29. Oktober 19 * Seite 2, Zeile 92 * Seite 3, Zeile 9 * Anspruch 1; Abbil	- Zeile 115 * - Zeile 125 *	1-3,7	F01D5/28 F01D5/18
X	•	LEE CHING-PANG ET AL) 02-10-03) bsatz '0030! * bsatz '0033! * bsatz '0039! *	1,5,6	
Α	US 6 214 248 B1 (BR AL) 10. April 2001	OWNING JANEL KOCA ET	1,2,7	
Α	* Spalte 2, Zeile 1 * Spalte 6, Zeile 5 * Zusammenfassung; Abbildungen *	2 - Zeile 28 * - Zeile 31 *	1-5,7	
A	US 2 641 439 A (WIL 9. Juni 1953 (1953- * Spalte 2, Zeile 6 * Abbildungen *	06-09)	2-4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CI.7) F01D F02K
A	19. Juni 2002 (2002 * Spalte 11, Absatz * Zusammenfassung;	40 - Absatz 42 * Abbildungen 6-11 * 	1	
Der vo		rde für alle Patentansprüche erstellt		
	Recherchenort .	Abschlußdatum der Recherche	0.0	Prûfer
X : von Y : von and A : tecl O : nic	DEN HAAG ATEGORIE DER GENANNTEN DOK besonderer Bedeutung allein betrach besonderer Bedeutung in Verbindung eren Veröffentlichung derselben Kate nologischer Hintergrund historitifiliche Offenbarung scheniteratur	tet E : älteres Patento nach dem Anm g mit einer D : in der Anmeldi gorie L : aus anderen G	zugrunde liegende lokument, das jedo eldedatum veröffe angeführtes Do ründen angeführte	ntlicht worden ist okument

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 03 00 6962

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

14-08-2003

	im Recherchenberic geführtes Patentdoku		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) Patentfam	der ilie	Datum der Veröffentlichung
GB	803650	Α	29-10-1958	BE FR NL	552543 1163161 212036	Α	23-09-1958
US	2002141872	A1	03-10-2002	KEI	NE		
US	6214248	B1	10-04-2001	KEIN	NE		
US	2641439	Α	09-06-1953	KEIN	 NE		
EP	1215183	Α	19-06-2002	US EP JP	1215183	A1	20-06-2002 19-06-2002 23-08-2002

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82

EPO FORM P0461